# LFEX レーザーシステムの高性能化 -熱光学歪の均一化に関する研究— 金邊 忠,河仲準二 福井大学 学術研究院 工学系部門 電気・電子工学講座 大阪大学レーザー科学研究所

## 1. はじめに

次世代エネルギー源として核融合の開発が進んでおり, 米国 LLNL では核融合研究施設 NIF が建設され,大阪大 学では高速点火用 10PW 10kJ 級レーザー(LFEX)を用 いた研究が行われている<sup>[1]</sup>。本研究は主増幅部のフラッ シュランプ励起によって発熱が生じ,その熱から発生する 熱光学歪の除去のための冷却手法について熱光学解析 を行った。

## 2.レーザー増幅システム

NIFとLFEXの主増幅部を図1に示す。核融合研究用 高出力レーザーとして繰り返しを必要とせず,1shotベース の設計である。レーザー増幅器はフラッシュランプを用い ている。レーザー媒質はブリュースター角配置である。フ ラッシュランプの励起速度の不均一性と媒質のエンド効果 によってレーザー媒質内の蓄積エネルギーに差が生じる。 励起に使用されなかったエネルギーは熱エネルギーに変 換され,発熱量の違いから,レーザー断面方向に温度差が 生じる。温度差の式を式(1)に示す。

$$\Delta T = Q_{ST} \cdot \chi \cdot \frac{1}{c \cdot D} \cdots$$
 (1)

 $\Delta T$  は温度差[ $\mathbb{C}$ ], $Q_{ST}$  は蓄積エネルギー密度[J/cm<sup>3</sup>],  $\chi$ はエネルギー利用係数,c は比熱[J/g $\mathbb{C}$ ],D は密度[g/cm<sup>3</sup>] を表す。この状態でレーザーを媒質に透過させるとレーザ 一断面方向に光路差が生じる。光路差の式を式(2)に示 す。

$$\frac{dS}{dT} = \frac{dn}{dT} + (n-1) \cdot \frac{1}{L} \cdot \frac{dL}{dT} \cdots$$
(2)

dS/dTは光路長の温度係数[10<sup>-6</sup>/°C],dn/dTは屈折率の温 度係数[10<sup>-6</sup>/°C],nは媒質の屈折率,(1/L)dL/dTは線膨張係 数[ $\mu$  m/°C],L は光路長[ $\mu$  m]を表す。式(1)と式(2)により 熱光学歪<sup>[2]</sup>が発生し式(3)に示す。

$$\Delta \lambda = \frac{dS}{dT} \cdot \Delta T \cdot L \cdots$$
 (3)

△ λは光学波面歪[μm]を表す。熱光学歪はレーザー 品質の低下を引き起こし、レーザーショットレートの制限要 因となる。

# 3. 熱光学歪の均一化手法

熱光学歪を低減するには、レーザー断面方向の温度差 を緩和させる必要がある。表 1 に熱光学歪の発生と低減 するための方法を示した。まず媒質に投入する熱量 Q<sub>TH</sub> を求める。NIFとLFEXのリアルなゲイン分布<sup>[2]</sup>に従った熱 量分布にする。NIFは12%,LFEXは2%のゲイン分布に なっている。その後、三次元 CAD ソフト Solidworks flow simulationを用いてレーザー媒質1 枚当たりの非定常熱 解析を行う。媒質はリン酸塩ガラスのLHG-8を用いた。媒 質のサイズはLFEXのリアルサイズである46×81×4[cm<sup>3</sup>] とし理想的な分布を得るため媒質の側面に断熱材を設置 した。媒質の初期温度は 20[℃]に設定し、1 秒で熱量の 投入を完了させた。冷却ガスは N<sub>2</sub>ガスを用い冷却温度を 19~20[℃],冷却時間を最大 7200[s],ガスの流速を 1[m/s] に設定した。冷却終了条件として,媒質の温度は周囲温度 の 0.13[℃]以下,媒質 1 枚当たりの波面歪量は 0.0025[µ m]以下の達成が必要とする。



表1. 熱光学歪の評価値

Input heat         APMLAB experiment         Wavefront distotion=W[µm]         Gain coefficient=g <sub>0</sub> [cm <sup>-1</sup> ]         Heat energy per stored energy x	V <sub>50</sub> =χ Real mo Gain di LFEX M Gain di LFEX M Gain di	odel del stribution 12%+A lodel stribution 2%+Sy	Lsymmetry vmmetry
Cooling     h=Nu⋅κ t Nu=0.037.Pr <sup>1/2</sup> .Re       ∂T ∂t = k <sup>2</sup> ∂T ∂t = k <sup>2</sup> ∂t       2.Thermal relaxation       Temperature distribution ΔT→0	Laser Material Size Initial temperature Heat input time Cooling Method Temperature Cooling Tine Flow Rate	LHG-8 46×81×4 20 1 N₂gas 19~20 7200 0~10	cm °C s °C s m/s
Thermo-optical         Cooling end condition           Temperature coefficient of refractive index dn/dT         1.Slab average temperature $\Delta c = \left(\frac{dn}{dT} + (n-1)\frac{1}{L}\frac{dL}{dT}\right) \Delta T \cdot L$ 2. $\Delta \lambda_{tsics} \leq 0.0025  \mu  m$			

## 4.NIFとLFEX のスラブ配置

図2にNIFとLFEXのスラブ配置<sup>33</sup>を示す。NIFはパワ ーアンプで5スラブ2パスとメインアンプで11スラブ4パ スの増幅を行い合計54スラブ分の増幅を、LFEXはメイン アンプで8スラブ4パスの増幅を行い合計32スラブ分の 増幅を行っている。波面歪量の計算はスラブごとで発生 する波面歪量の和で合計される。NIFとLFEXの波面歪 量は図2の式で想定できる。上の式は単純に全波面歪量 を足し合わせた計算で、下は端スラブの反転、つまり偶数回 パスと奇数回パスで端スラブの波面歪量が打ち消される 効果を考えた式になっている。



# 図2.NIFとLFEX のスラブ配置

## <u>5.NIFの波面歪量</u>

図 3(a)にスラブの奇数枚配置と偶数枚配置のゲイン係数の比較を示す。端スラブでは奇数枚配置は偶数枚配置に比べて 23%のゲイン分布の均一化が可能で左右対称な分布に出来ることを示す。図 3(b)にスラブを 54 枚並べた時の波面歪量を示す。X 配置なら16[ $\mu$  m],ダイアモンド配置なら10[ $\mu$  m],インテリア配置なら8[ $\mu$  m],NIF Total なら6[ $\mu$  m]の波面歪量が生じることを示す。Best Placementは図 2 の下の効果を用いた計算結果で、端スラブの波面打ち消し効果で X 配置とダイアモンド配置の波面歪量が0になるとすると、NIFの波面歪量はインテリアスラブ 42 枚分しか効いていない計算になる。Best Placementの線はNIF Total の線と似た線となっており NIF の波面歪量<sup>[4]</sup>の計算は下の効果を使用していると考えられる。



## <u>6. 冷却結果</u>

図4にLFEXとNIFモデルの時間経過に対するスラブ平 均温度と波面歪量緩和を示す。冷却は N<sub>2</sub> ガス l[m/s]を 20[°C],19.5[°C],0 3 パターンで行った。グラフの線か ら冷却ガス温度を 0.5[°C]下げるごとに温度緩和時間が 6000[s]、4000[s]、2000[s]と減少した。スラブ平均温度を減少 するのが目的ならガス温度を下げれば解決できることがわ かる。NIF は LFEX と比べて利得分布が大きいため,波面歪 量の目標値  $0.0025[\mu m]$ を2時間では達成できなかった。

# 7.繰り返し動作の評価

リン酸塩ガラス LHG-8 は媒質の熱伝導率が低いため内 部の熱が取り出せず,媒質の熱破壊が発生する問題があ る。図 5 に熱伝達係数が一定値の時のショットレートと熱 破壊限界の関係を示す。媒質では LHG-8 より APG-1 の 方が熱に強く,励起法ではフラッシュランプ励起より LD 励 起の方が 10 倍以上も熱影響を少なく出来る。現状フラッシュランプ励起は媒質の種類や熱伝達係数を変えて 0.1 ~0.01Hz 程度のショットレート改善が見込める可能性がある。





図5.繰り返し動作の熱緩和

# <u>8.まとめ</u>

本研究では NIF、LFEX 増幅部のフラッシュランプ励起不 均一性で発生するゲイン分布を配置によって均一化し波面 歪量を減少させる方法と波面歪量の計算を説明した。NIF の波面歪量はインテリアスラブ 42 枚分の波面歪量の和に近 いことを示した。リアルモデルの温度と波面歪量の目標値達 成の時間を求めた。ショットレートを変えた時の媒質や励起 の種類によって決まる熱破壊限界を示し、フラッシュランプ励 起の限界を示した。

## 参考文献

 T.Kanabe :OPTRONICS, **31**, 118(2012).
 J.M.EGGLESTON *et al.*:IEEE.J.QUANTUM ELECTRONICS, **20**, NO 3, 289 (1984).
 John T. Hunt, "National Ignition Facility Performance Review 1998," *UCRL-ID-138120-98 NIF-0025088*, June, (1999).
 D.L.Brown, G.T.Mannell, "Thermal Analysis of the Large Close Packed Amplifiers in the National Ignition Facility(NIF)", *UCRL-JC-120211 L-19595-2 PREPRINT*, June 1,(1995).